AlGaN 系深紫外 LED

平山秀樹*,**

AlGaN-Based Deep-UV LEDs

Hideki HIRAYAMA*, **

High-efficiency deep-ultraviolet (DUV) light-emitting diodes (LEDs) and laser diodes (LDs) have a wide range of potential applications such as sterilization, water purification, medicine and biochemistry, white light illumination, and so on. We demonstrated 220-350 nm-band DUV LEDs using wide-bandgap AlGaN semiconductors. Low threading dislocation density (TDD) AlN buffer layers on sapphire substrates were realized by using an "ammonia (NH₃) pulse-flow multilayer (ML) growth" technique. We achieved significant increase of internal quantum efficiency (IQE) of AlGaN quantum well (QW) DUV emission from about 0.5% to more than 50% by reducing the TDD. We demonstrated further increase of IQE (>80%) using carrier-localization effects in In-segregation area. We also obtained significant increase of electron injection efficiency (EIE) (from 20% to more than 80%) by introducing multi-quantum barrier (MQB). We then obtained about 4% external quantum efficiency (EQE) and over 30 mW CW output power for "sterilization-use" DUV LEDs.

Key words: AlGaN, deep-UV LED, AlN, metal organic chemichal vapor deposition (MOCVD), internal quantum efficiency

波長 220~350 nm の半導体深紫外光源(LED・LD)は, 殺菌・浄水,医療分野・生化学産業,高密度光記録用光源 や白色照明,紫外硬化樹脂等への産業応用,蛍光分析など の各種センシング,酸化チタンとの組み合わせによる環境 破壊物質(ダイオキシン,環境ホルモン,PCB等)の高速 分解処理などの幅広い応用が考えられ,その実現が期待さ れている(図1).殺菌効果では,DNAの光吸収波長と重 なる260~280 nm 付近の波長で最も効果が高いことが知ら れている.深紫外 LED,LD は,高効率化が進むにつれ市 場規模が飛躍的に拡大すると考えられ,その開発は今後の 重要課題のひとつである¹⁻³⁾.

AlGaN 系材料のバンドギャップエネルギーは、GaN の 3.4 eVから AlN の 6.2 eVの広い深紫外発光領域をカバーし ている。それに加え、① 全組成領域において直接遷移型 半導体である、② 量子井戸からの高効率深紫外発光が可 能である^{2.3)}、③ p・n 型半導体の形成が可能である、④ 材 料が堅く素子寿命が長い、⑤ 砒素、水銀、鉛などの有害な 材料を含まず環境に安全である,等の特徴をもつ.これらの理由により,実用可能な深紫外発光素子を実現するための材料として,AlGaN系材料はもっとも有力である.

図2に,最近報告されている窒化物深紫外LEDの外部量 子効率(EQE)をまとめる.近年,深紫外LED・LDの短 波長化と高効率化に向けた激しい開発競争が行われてい る⁴⁻¹⁷⁾.2002年以降アメリカ,サウスカロライナ大学は世 界の先頭を切って波長250~280 nmのAlGaN量子井戸 LEDを実現した⁴⁾.その後,2006年に最短波長(210 nm) のAlN-LEDが実現されている⁵⁾.理化学研究所(理研)で は222~351 nm 波長のAlGaN およびInAlGaN四元量子井 戸LEDを実現し⁶⁻¹³⁾,短波長領域での高効率動作を実現し ている.また,殺菌波長260~280 nmにおいて10 mW 以 上の室温CW出力を2008年に実現するなど,実用レベル の高出力化に成功した.2010年になり,いくつかの企業 が開発を始め¹⁴⁻¹⁶⁾,開発競争はいよいよ激しくなってき た.現在,最高5%のEQE¹⁴⁾,シングルチップで100 mW

^{*}理化学研究所(〒351-0198 和光市広沢 2-1) E-mail: hirayama@riken.jp

^{**}科学技術振興機構 CREST (〒332-0012 川越市本町 4-1-8)



図1 深紫外 LED・LD の応用分野.

を超える深紫外 LED がすでに報告されている.

しかし,図2に示すように,波長が360 nm よりも短波 のAlGaN系深紫外LEDでは,EQEがInGaN系の青色LED に比べてまだ低い. 今後,図2に示したように数十%の効 率を実現することが深紫外LEDの課題である.

AlGaN 系深紫外 LED 高効率化への問題点とアプ ローチ

AlGaN 系深紫外 LED 高効率化への課題は以下のように まとめられる.

- ① 低貫通転位密度 AIN の実現が難しい。AlGaN の発光 内部量子効率は貫通転位により著しく低下する。
- ② AlGaN の高濃度 p 型化が難しいため、電子リークが 大きく、量子井戸への十分な電子注入効率が得られ ない.また、素子過熱が問題となる。
- ③ p 型層と電極での光吸収のため、光取り出し効率が 10%以下と低い。

①に関しては、AlN バッファーの貫通転位密度の低減 に成功し高い内部量子効率(IQE)を実現したいくつかの グループ(図2参照)が、深紫外LEDの実現を成し遂げて いる.理研では「アンモニアパルス供給多段成長法」を導 入して AlN の貫通転位密度を低減し、高出力深紫外 LED を実現している. AlGaN 量子井戸から高い IQE を得るた めには、刃状転位密度を 3×10⁸ cm⁻² 以下にすることが重 要であることが本研究でわかってきた.

② について,Mg アクセプターの活性化エネルギーは物



図2 報告されている AlGaN 系深紫外 LED の外部量子効率.

性値で変えがたいため、AlGaN やAlNのp型高濃度化の有 力な方法はまだ見つかっていない。一方われわれは、多重 量子障壁(MQB)電子ブロック層を用いることにより、 量子井戸への電子注入効率の大幅な改善を行っている。

③については、p側高反射電極の導入や、サファイア裏 面への二次元フォトニック結晶加工による光取り出し効率 の向上などが検討されはじめており、今後の大幅な向上が 期待されている.

2. AIN 結晶の高品質化と AlGaN 系深紫外 LED の実現

図3に、「アンモニアパルス供給多段成長法」^{68.9)} によるAIN バッファー成長の概念と、用いたガスフローシーケンスを示す.これは、①低い貫通転位密度、②原子層オーダー平坦性、③クラックの防止、④安定したⅢ族極



図3 アンモニアパルス供給多段成長法による AlN 成長の概 念と用いたガスフローシーケンス.

性を一度に満たすものとして考案された方法である. 高効 率深紫外 LED 用途として実用レベルのテンプレートを供 給でき,また,大面積(4インチ)均一成長にも成功して いる.まず,パルス供給により高品質 AIN 結晶の核を基板 上に形成したあと,横方向によく成長するパルス供給成長 法を用いて埋め込み,貫通転位密度をできるだけ減少させ る.その後,連続供給による高速縦方向成長と低速パルス 供給成長による AIN 層を交互に繰り返すことで,クラック を防止しながら原子層オーダーの平坦性と貫通転位の低減 を実現するのがその原理である.アンモニアパルス法を用 いることにより,マイグレーションエンハンス成長が可能 であるばかりでなく,安定したⅢ族極性を維持しながら成 長が可能で,極性反転による異常核成長を大幅に抑制する ことができる.実際には,パルスおよび連続供給 AIN 層を 5 段程度成長する.

図4に, AIN 各層を導入したときの(a) X線回折(10-12) 方向 ω スキャンロッキングカーブ半値幅(XRC(10-12) FWHM)(刃状転位密度に対応)の減少と,(b) AFM によ る表面平坦性の観測を示す.この方法を用いて,XRC (10-12) FWHM は 250 arcsec 程度が得られ,3×10⁸ cm⁻² 程度の刃状転位密度が得られた⁹⁾.また,AFM 像からは 原子層平坦性(RMS 値:0.16 nm)が確認された.

低貫通転位 AIN 上に AlGaN 量子井戸の作製を行い,高 効率深紫外発光を実現した.図5に(a) AlGaN 量子井戸の 断面透過電子顕微鏡(TEM)像と,(b)X線半値幅減少に 伴う量子井戸のフォトルミネセンス(PL)発光の増加の様 子を示す.量子井戸内部のピエゾ電界による発光効率低下 を防ぐため,薄い量子井戸(1.3~1.6 nm)を用いている. したがって,図5に示すように,原子1層程度の平坦性を 得ることが高効率発光を得る上で重要な条件である.貫通 転位密度を低減することにより,AlGaN 量子井戸発光の 飛躍的な増強が観測された.従来,AINの貫通転位密度が



図4 AIN 成長における (a) XRC (10-12) FWHM (刃状転 位密度に対応)の減少と, (b) AFM による原子層平坦性 の観測 (5×5μm 領域).

1×10¹⁰ cm⁻³ 程度の場合,AlGaN 量子井戸の IQE は 0.5% 以下であったのに対し,低貫通転位密度 (<5×10⁸ cm⁻²) の AlN を用いることにより,IQE は 100 倍程度増強され た.PL 積分強度の温度依存性から,AlGaN 量子井戸の室 温における IQE は 30%以上と見積もられた⁹.

さらに、紫外 LED 高効率化の方法として、In の混入が 有効である。In をサブ%~数%程度含む InAlGaN 四元混 晶は、In の組成変調効果によって AlGaN よりも高い効率 で発光することが実験的に明らかになり^{3,9,18,19},高効率紫 外 LED・LD の発光材料として大変期待されている。図 6 に、AlGaN および InAlGaN 量子井戸の低温と室温における PL 発光の積分強度比 (IQE に対応)を示す。低温 (<15 K) において発光再結合が非発光再結合に比べ支配的であ ることから、低温と室温における PL 発光強度比を測定す ると、室温における IQE をおおよそ見積もることができる。 従来、貫通転位密度が高かったときは、In 混入効果で高 効率化を図った。しかし、図 6 に示すように、300 nm よ りも短波では高効率発光が得られなかった。その後、低貫 通転位密度が実現してからは短波において高効率発光が実



図5 (a) AlGaN 量子井戸の断面 TEM 像, (b) X 線半値幅減少に伴う量子井戸発光の飛躍的増加.



図 6 AlGaN および InAlGaN 量子井戸の低温と室温に おける PL 発光の積分強度比(内部量子効率に対応).

現し, AlGaN および InAlGaN 量子井戸でそれぞれ 30%, 80%以上の積分強度比が得られた. この結果から, In 混 入により, AlGaN よりも高い IQE が実現できることが明 らかになった⁹.

図7に,作製した AlGaN 量子井戸深紫外 LED の構造と 発光の様子を示す.サファイア基板上に,「アンモニアパ ルス供給多段成長法」による AlN バッファー層,n-AlGaN 層,i-AlGaN/AlGaN 3 層量子井戸発光層,p-AlGaN 電子ブ ロック層,p-AlGaN 層,p-GaN コンタクト層を成長した. 波長 220~280 nm を得るために,40~90%の高い Al 組成 比の AlGaN を各層に用いている.図8に,AlGaN ならびに InAlGaN 量子井戸 LED から得られた電流注入発光(EL) スペクトルを示す.波長 222~351 nm のすべての LED で シングルピーク動作が得られた.222 nm は AlGaN 量子井 戸 LED の最短波長である.不純物などからのディープレ ベル発光はいずれのスペクトルにおいても2桁以上弱く, 良好な動作が得られている.

本研究では 2008 年夏に,量子井戸層,n型層,p型層す



図 7 (a) AlGaN 量子井戸 LED の構造, (b) 発光の様子.



図8 AlGaN, InAlGaN 量子井戸 LED の動作スペクトル.



図9 深紫外LEDの電子ブロック層として, MQBを用いた場合 (a) と, 従来のシングルバリアーを用いた場合 (b)の電子の反射効果の概念.

べてに InAlGaN 四元混晶を用いた深紫外 LED を作製し, 波長 280 nm 帯において,世界初の 10 mW を超える深紫外 LED を実現した.この結果により,深紫外 LED が殺菌用 途として実用化可能であることが示された⁹.

3. 多重量子障壁 (MQB)を用いた電子注入効率の改善

AlGaN 深紫外 LED では, p型AlGaN のホール濃度が 1× 10¹⁴ cm⁻³ 以下ときわめて小さいため,注入された電子 は, p層側にリークし,発光領域への電子注入効率 (EIE) が著しく低下する.そのため通常,電子ブロック層を量子 井戸の p層側に挿入し,電子のリークを阻止する.しか し,電子ブロック層にAlNを用いた場合においても,電子 の反射効果は十分ではなく,250 nm 帯 LED では EIE は依 然として 20%以下と低いことがわかってきた¹⁰.

EIE をさらに大幅に改善するためには, MQB を用いる ことが効果的である¹⁰⁾. 図9に, 深紫外 LED の電子ブロッ ク層として (a) MQB を用いた場合と, (b) 従来のシング ルバリアーを用いた場合の電子の反射効果について示す. 従来のシングルバリアーを用いた場合には, 電子ブロック 高さ以上のエネルギーの電子は反射されずに p 側にリーク し, 発光層への EIE を低下させた. 一方, MQB を用いた 場合, 電子の多重反射効果により, 材料限界で決まる障壁 高さよりもさらに高い「実効的」障壁高さを実現すること



図 10 MQB を導入した深紫外 LED の構造と断面 TEM 像.



図 11 MQB 導入による (a) 250 nm 帯と, (b) 235 nm 帯 AlGaN 深紫外 LED の出力の向上.

ができる.シミュレーション計算から,AlGaN 系 MQB で は、シングルバリアーの場合に比べ2倍以上の実効的障壁 高さが得られることがわかった.

図 10 に, MQB を導入した深紫外 LED の構造と断面 TEM 像,図11に,MQB 導入による(a) 250 nm 帯と(b) 235 nm 帯 AlGaN 深紫外 LED の出力の向上について示す. 実際に用いた変調周期 MQB 構造では、周期数、バリ アー・バレイの各膜厚, MQB 領域のトータル層厚など を、反射効果が最も高まるように実験的に最適化した。図 11に示すように、波長250 nmのAlGaN 深紫外 LED におい て, 光出力は 2.2 mW から 15 mW まで (7 倍) 向上した. 同様に、短波の 235 nm では 12 倍の出力向上が観測され た. また, 270 nm 帯 LED では最高 CW 出力 33 mW が得ら れ, MQBの効果の有効性が示された。図12に、AlGaN深 紫外 LED における MQB 効果の波長依存性を示す。MQB の効果はこれまでに 230~270 nm 帯の LED で観測され、 270 nm で約3倍, 250 nm で約4倍, 235 nm では約8倍の EQE 向上が確認された. このように MQB 導入で高い EQE が実現され、現在、270 nm で 3.8%、247 nm で 1.8%、 237 nm で 0.4%が得られている。また、MQB 効果は、バ リア高さが小さい短波長深紫外 LED で、より顕著である



ことがわかった.

深紫外 LED の効率の内訳について議論する. IQE は PL の温度依存性から,また,光取り出し効率(LEE)は LED 層構造の屈折率分布から計算でおおむね求めることができ る.したがって,EIE については,EQE=IQE×EIE×LEE の関係から逆算で求めることができる.270 nm 帯 LED (EQE:3.8%)の内訳は,おおよそ,IQE:60%,EIE: 80%,LEE:8%と見積もられた.同様の方法で250 nm 帯 LEDのEIEを見積もると,MQBの効果でEIEが約20%か ら80%以上に向上することが見積もられた.このよう に,MQB 導入で高いEIE が得られ,p型 AlGaNの低濃度 に起因する電子リークの問題は,MQB によりおおむね解 決できることがわかってきた¹⁰⁾.さらに,MQB は電流密 度が大きいときに効果を発揮するため,LED 高出力動作 時の効率向上(効率ドゥループ現象の抑制)やLDの低閾 値・高効率動作において大きな効果が期待できる.

4. 光取り出し効率の改善

深紫外 LED の LEE は、Ni/Au p 型電極とコンタクト層 における紫外光吸収によって低減し、8%と低い値となる. したがって、今後、LEE 向上は深紫外 LED のもっとも重 要な課題である.LEEを向上させるためには、p-GaN コン タクト層の薄膜化と高反射電極の導入が有効である.また 青色 LED のときと同様に、サファイア裏面への二次元 フォトニック結晶加工、パターンサファイア基板 (PSS) の導入も効果がある.

われわれは、p-GaN コンタクト層を極薄膜化して光吸収 を低減し、また、Al系電極を用いることでp型高反射を実 現し、トータルで4倍程度の効率向上を狙っている(図13 参照). p-GaN コンタクト層を3 nm 程度にすることで、光 吸収を10%程度に抑えられることを実験的に明らかにし ている、良好なオーミック抵抗を実現するためには厚いコ



図 13 p-GaN コンタクト層薄膜化と Al 系高反射電極を用いた光 取り出し効率の改善の概念.



図 14 2007~2011 年における理研 AlGaN 系深紫外 LED の出力向上の経緯.

ンタクト層が望ましく,条件はトレードオフの関係にあ る.今回は 10 nm の薄い p-GaN コンタクト層で良好な LED 動作の実現に成功しており,さらに薄い膜厚も検討 中である.Al は深紫外光に対して反射率 92%程度である が,オーミックコンタクトが得られない.極薄(1 nm)の Niを導入することで,コンタクトを取りながら高反射を 実現できる.従来のNi/Au 電極では約30%の反射率であっ たのに対し,Ni(1 nm)/Al(100 nm)では 65%程度の反 射率が得られている.最適化によりさらに反射率の向上が 可能であると考えられる.

電極を Ni/Au から Al 系に変更することによって,最高 EQE は約 1.3 倍向上した.まだ最適化されていないため効 果が不十分であるが,今後さらなる効率向上が期待される.

図 14 に,2007~2011 年における理研の AlGaN 系深紫外 LED の出力向上についてまとめた.AlN 結晶の貫通転位の 低減,In 混入,MQB の導入,高反射 p 型電極の利用など で深紫外 LED の大幅な高出力化を実現した.現在,250~ 275 nm で 15~33 mW の室温 CW 出力が得られている.ま た,237 nm で 4.8 mW の CW 出力(従来は 0.4 mW 程度)が 得られ, MQB の効果で短波長 LED は飛躍的に高出力化した.

AlGaN をベースとした深紫外 LED の現状について概説 した.「アンモニアパルス供給多段成長法」を考案し AlN バッファーの貫通転位密度を従来に比べ 2 桁程度低減し た.転位の低減により AlGaN 量子井戸の IQE の飛躍的向 上 ($0.5\% \rightarrow 50\%$ 程度)を実現し、それを用いて 222~351 nmの幅広い波長の LED を実現した.さらに In 混入効果を 用い、より高い IQE を実現した.また、MQB を導入し、 EIE を大幅に改善した.これらの効果で、波長 230~270 nm における高出力 LED を実現し、特に殺菌用途波長にお いて連続出力 30 mW 以上の高出力深紫外 LED を実現し た.今後は、光取り出し効率を向上することにより高効率 化が進むと考えられる.今後、深紫外 LED の発光効率は、 青色 LED と同様の歴史をたどり、近い将来、数十%に向 上することが期待される.

文 献

- 1) 平山秀樹: "AlGaN 系殺菌用途紫外 LED の進展と今後の展 望",表面技術, 61 (2010) 637-640.
- 平山秀樹,藤川紗千恵,塚田悠介,鎌田憲彦: "AlGaN 系深紫 外 LED の進展と展望",応用物理,80 (2011) 319-324.
- H. Hirayama: "Quaternary InAlGaN-based high-efficiency ultraviolet light-emitting diodes," J. Appl. Phys., 97 (2005) 091101.
- 4) V. Adivarahan, W. H. Sun, A. Chitnis, M. Shatalov, S. Wu, H. P. Maruska and M. Asif Khan: "250 nm AlGaN light-emitting diodes," Appl. Phys. Lett., 85 (2004) 2175–2177.
- Y. Taniyasu, M. Kasu and T. Makimoto: "An aluminium nitride light-emitting diode with a wavelength of 210 nanometres," Nature, 441 (2006) 325–328.
- 6) H. Hirayama, T. Yatabe, N. Noguchi, T. Ohashi and N. Kamata: "231-261 nm AlGaN deep-ultraviolet light-emitting diodes fabricated on AlN multilayer buffers grown by ammonia pulse-flow method on sapphire," Appl. Phys. Lett., **91** (2007) 071901.
- H. Hirayama, K. Akita, T. Kyono, T. Nakamura and K. Ishibashi: "High-efficiency 352 nm quaternary InAlGaN-based ultraviolet light-emitting diodes grown on GaN substrates," Jpn. J. Appl. Phys., 43 (2004) L1241–L1243.

- 8) H. Hirayama, N. Noguchi, T. Yatabe and N. Kamata: "227 nm AlGaN light-emitting diode with 0.15 mW output power realized using thin quantum well and AlN buffer with reduced threading dislocation density," Appl. Phys. Express, 1 (2008) 051101.
- 9) H. Hirayama, N. Noguchi, S. Fujikawa, J. Norimatsu, T. Takano, K. Tsubaki and N. Kamata: "222-282nm AlGaN and InAlGaN based high-efficiency deep-UV-LEDs fabricated on high-quality AlN on sapphire." Phys. Status Solidi A. 206 (2009) 1176–1182.
- 10) H. Hirayama, Y. Tsukada, T. Maeda and N. Kamata: "Marked enhancement in the efficiency of deep-ultraviolet AlGaN lightemitting diodes by using a multiquantum-barrier electron blocking layer," Appl. Phys. Express, 3 (2010) 031002.
- H. Hirayama, N. Noguchi and N. Kamata: "222 nm deep-ultraviolet AlGaN quantum well light-emitting diode with vertical emission properties," Appl. Phys. Express, 3 (2010) 032102.
- 12) H. Hirayama: "Short-wavelength high-efficiency deep-UV LEDs realized by improving injection efficiency," *International Workshop on Nitride Semiconductors 2010 (IWM2010)*, A1.1 (Tampa, Florida, 2010) pp. 16–20.
- 13)藤川紗千恵,平山秀樹,前田哲利:"a 軸方向傾斜 c 面サファ イア上に作製した高効率深紫外 LED",第 58 回応用物理学関 係連合講演会,24a-BY-5 (2011).
- 14) C. Pernot, M. Kim, S. Fukahori, T. Inazu, T. Fujita, Y. Nagasawa, A. Hirano, M. Ippommatsu, M. Iwaya, S. Kamiyama, I. Akasaki and H. Amano: "Improved efficiency of 255-280 nm AlGaNbased light-emitting diodes," Appl. Phys. Express, 3 (2010) 061004.
- 15) A. Fujioka, T. Misaki, T. Maruyama, Y. Narukawa and T. Mukai: "Improvement in output power of 280-nm deep ultraviolet lightemitting diode by using AlGaN multi quantum wells," Appl. Phys. Express, 3 (2010) 041001.
- 16) 大鹿嘉和,柴田智彦: "AlN テンプレートを用いた 300 nm 帯高 効率深紫外 LED の諸特性",第 57 回応用物理学会学術講演 会,19p-TB-14 (2010).
- 17) H. Yoshida, Y. Yamashita, M. Kuwabara and H. Kan: "Demonstration of an ultraviolet 336 nm AlGaN multiple-quantum-well laser diode," Appl. Phys. Lett., 93 (2008) 241106.
- 18) H. Hirayama, T. Yamabi, A. Kinoshita, Y. Enomoto, A. Hirata, T. Araki, Y. Nanishi and Y. Aoyagi: "Marked enhancement of 320-360 nm UV emission in quaternary In_xAl_yGa_{1-xy}N with In-segregation effect," Appl. Phys. Lett., **80** (2002) 207–209.
- H. Hirayama, Y. Enomoto, A. Kinoshita, A. Hirata and Y. Aoyagi: "Room-temperature intense 320 nm-band UV emission from quaternary InAlGaN-based multi-quantum wells," Appl. Phys. Lett., 80 (2002) 1589–1591.

(2011年5月6日受理)